(54) MOUNTING STRUCTURE AND MOUNTING METHOD OF TAPE CARRIER

(19) JP (43) 5.6.1992 (11) 4-162449 (A)

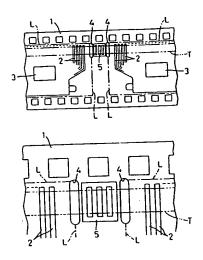
(21) Appl. No. 2-286854 (22) 24.10.1990

(71) SEIKO EPSON CORP (72) KUNIO MARUYAMA

(51) Int. Cl⁵. H01L21/60

PURPOSE: To stick tapes for fixing firmly onto base material films through metallic foil patterns by forming the metallic foil patterns onto the base material films among adjacent wiring groups.

CONSTITUTION: A metallic foil pattern 5 is formed onto a base material film 1 between adjacent wiring groups 2, 2, and a tape T for fixing is stuck onto the base material film 1 through the metallic foil pattern 5. When a tape carrier is mounted, the wiring groups 2 are punched by cut lines L at every unit, and the OLB terminals of each wiring group are bonded with members to be connected, and each wiring group 2 is fastened firmly onto the base material film 1 through the metallic foil patterns by the tape T for fixing. The base material film is introduced continuously to an OLB process under the state of the fixed tape, and the tape T for fixing is cut in the slit holes 4 and bonded, thus continuously conducting operation.



(54) DETECTING METHOD FOR BREAKING OF WIRE IN ULTRASONIC WEDGE BONDING

(11) 4-162441 (A)

(43) 5.6.1992 (19) JP

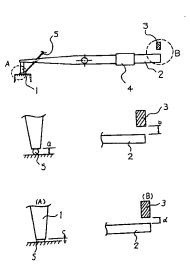
(21) Appl. No. 2-286160 (22) 24.10.1990

(71) NEC YAMAGATA LTD (72) MASANOBU IKENO

(51) Int. Cl⁵. H01L21/607,H01L21/60

PURPOSE: To detect the breaking of a wire even in ultrasonic wedge bonding conducting no ball-up of the wire by converting the quantity of displacement of the sinking of an ultrasonic horn due to the crush of the wire into voltage by a displacement sensor and deciding the presence of the wire from voltage difference before oscillation and after oscillation.

CONSTITUTION: A horn 2 can be rocked around a support shaft, and vibrated by an ultrasonic vibrator, and a wire 5 is joined by the wedge 1 of one end. A displacement sensor 3 is mounted at a fixed distance on the other end of the horn 2. When the wire 5 is contact-bonded through an ultrasonic oscillation method, the wire 5 is crushed, the height of the wedge 1 is changed from (a) to (c), and the distance (d) of the displacement sensor 3 and the horn 2 is turned into (d). The distance (b) corresponds to voltage V_b and the distance (d) to voltage V_d , and the presence of the wire is decided on $V_b - \cdot V_d > 0(V)$. Since no (a), (c) changes due to the crush of the wire and b=d holds on the absence of the wire, $V_b - V_d = 0(V)$ holds, and the absence of the wire is judged.



4: ultrasonic oscillator

(54) SEMICONDUCTOR WAFER

(43) 5.6.1992 (19) JP (11) 4-162442 (A)

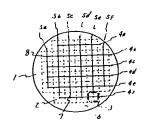
(21) Appl. No. 2-286175 (22) 24.10.1990

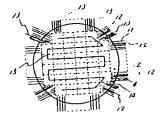
(71) NEC KYUSHU LTD (72) KAZUNORI NISHIYAMA

(51) Int. Cl⁵. H01L21/66,H01L21/3205,H01L27/04

PURPOSE: To omit mechanical alignment, and to shorten a testing time by providing electrode buses connected to each of pad electrodes through electrode selecting switches and a row and column selecting bus selecting an arbitrary chip region and switching the electrode selecting switches.

CONSTITUTION: Row and column selecting buses 6, 7 corresponding to the array of chip regions formed onto a wafer are mounted, and the AND of lines rows is detected by a raw and column coincidence detecting element 8 in chip selecting signals input from row and column selecting pads 4a-4f, 5a-5f. The electrode connecting switches of all of chip regions 2, in which detecting signal outputs are selected, are conducted. That is, all the electrode pads on an arbitrary selecting chip region are connected only to electrode buses, and bonded with probes 11 through probe pads 14. The arbitrary chip region is connected successively to the probes 11 by controlling chip selecting signals input from row and column selecting probes 12, 13 and a characteristic test is conducted under the state of the probes in a semiconductor wafer.





THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 04162440 A

(43) Date of publication of application: 05.06.92

(51) Int. Cl **H01L 21/60**

(21) Application number: 02286854

(22) Date of filing: 24.10.90

(71) Applicant:

SEIKO EPSON CORP

(72) Inventor:

MARUYAMA KUNIO

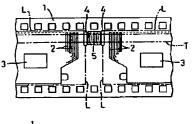
(54) MOUNTING STRUCTURE AND MOUNTING METHOD OF TAPE CARRIER

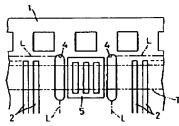
(57) Abstract:

PURPOSE: To stick tapes for fixing firmly onto base material films through metallic foil patterns by forming the metallic foil patterns onto the base material films among adjacent wiring groups.

CONSTITUTION: A metallic foil pattern 5 is formed onto a base material film 1 between adjacent wiring groups 2, 2, and a tape T for fixing is stuck onto the base material film 1 through the metallic foil pattern 5. When a tape carrier is mounted, the wiring groups 2 are punched by cut lines L at every unit, and the OLB terminals of each wiring group are bonded with members to be connected, and each wiring group 2 is fastened firmly onto the base material film 1 through the metallic foil patterns by the tape T for fixing. The base material film is introduced continuously to an OLB process under the state of the fixed tape, and the tape T for fixing is cut in the slit holes 4 and bonded, thus continuously conducting operation.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio





THIS PAGE BLANK (USPTO)

日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-162440

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

公開 平成 4年(1992) 6月5日

H 01 L 21/60

3 1 1 R

6918-4M

審查請求 未請求 請求項の数 2 (全5頁)

会発明の名称

テープキャリアの実装構造および実装方法

②特 願 平2-286854

22出 願 平2(1990)10月24日

@発 明 者 丸 Ш

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

创出 願 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

何代 理 弁理士 菅 λ 外1名 直 人

> 明 **201**

1. 発明の名称

テープキャリアの実装構造および実装方法

2. 特許請求の範囲

(1) テープキャリアの基材フィルム上に複数単 位連続的に形成された配線群を、1単位毎に基材 フィルムから打ち抜いて実装するに当たり、その 配線群と、隣り合う配線群間の基材フィルム上と に固定用テープを貼着することにより、配線群が 基材フィルムから1単位毎に打ち抜かれた後も、 配線群が基材フィルム上に固定されるようにした ものにおいて、隣り合う配線群間の基材フィルム 上に金属箔パターンを形成し、その金属箔パター ンを介して上記固定用テーブを基材フィルム上に 貼着するようにしたことを特徴とするテープキャ リアの実装構造。

(2)テープキャリアの基材フィルム上に複数単 位連続的に形成された配線群を、Ⅰ単位毎に基材 フィルムから打ち抜いて実装するに当たり、隣り 合う配線群間の基材フィルム上に形成した金属箔

パターンと上記配線群とに固定用テープを貼着す ることにより、上記配線群が1単位毎に打ち抜か れた後も、各配線群が基材フィルム上に固定され たテープ状態でアウターリードボンディングを行 うようにしたことを特徴とするテープキャリアの **芙装方法。**

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、フレキシブルプリンティッドサーキ ット等のテープキャリアの実装構造および実装方 法に関する。

〔従来の技術〕

例えば液晶表示装置等における部品相互間の配 線接統部材として、合成樹脂等よりなる可撓性基 材フィルム上に配線を施してなるフレキシブルプ リンティッドサーキット(以下、FPCという) が用いられている。特に液晶表示装置における液 晶表示パネルと、その駆動制御回路基板との間に は、LSI等の液晶駆動用の半導体チップをTA B (Tape Automated Boading)方式等で実装したで

P C が用いられている。

上記のようなFPCは、例えばしつの半導体チャプに対する複数本の入出力用配線群をし単位とし、これをテープ状の基材フィルム上に連続的に多数形成していわゆるテープキャリアを構成し、接続すべき部材にアウターリードボシディング(以下、OLBという)を行うに当たっては、テープ状の基材フィルムから前記の配線群を1単位毎に打ち抜いて分離し、非テープ状態でOLBを行っていた。そのため、OLB工程の自動化が困難の不具合があった。

そこで、本出願人は先に特願平1-221228号において、前記の配線群を固定用テープにより基材フィルムに固定することにより、配線群が1単位毎に打ち抜かれた後も、テープ状態のままでOLBが行えるようにすることを提案した。

第4図~第6図はその一例を示すもので、図において1はFPCの基材フィルムであり、その基材フィルム1上に配線群2を形成すると共に、そ

- 3 -

しかしながら、上記基材フィルム1の表面は平 坦であるため、隣り合う配線群2・2間の基材フィルム表面に固定用テープTが貼着しずらい。特 に固定用テープTの押し付け力が弱かったり、温 度が低い場合には充分な粘着力が得られず、固定 用テープTの基材フィルム1と反対側の面にセパレータ(剝離紙)T1を有するものにあっては、 そのセパレータを剝がす際に、繰り合う配線群2 ・2間の固定用テープTが基材フィルム1から剝 がれるおそれがあった。

そこで、固定用テープTを強い圧力で基材フィルムに押し付けたり、温度を高めると、基材フィルムに対する固定用テープTの粘着力は増大するが、固定用テープTが薄くなったり、前記のようなスリットホール4を設けるものにあっては、そのスリットホール4内に固定用テープTが気いる等のおそれがあった。

本発明は上記従来の問題点に捨みて提案された もので、隣り合う配線群2・2間の基材フィルム の配線群2のインナーリード部にLS I 等の液晶 駆動用の半導体チップ3がTAB方式等により実 装されている。Tは固定用テープで、その固定用 テープでは配線群2の上面および隣か合う配線群 2・2間の器材フィルム上面に連続的に貼着され ている。

上記各単位毎の配線群 2 は、外形カットラインしの位置で基材フィルム 1 からカットされるが、カット後も固定用テープTにより基材フィルム 1 に連結された状態に保持される。図中4 は上記カットラインしと固定用テープTとの交差部において基材フィルム 1 に予め形成したスリットホールであり、前記カット時に該スリットホール4 の内側部分をカットしないようにすることにより、固定用テープTの切断が防止され、基材フィルム 1 に配線群 2 が連結された状態に保持される。

上記のように基材フィルム1に配線群2を連結・した状態に保持することにより、テープ状態のま・までOLBを行うことができるものである。

〔発明が解決しようとする課題〕

- 4 -

1上に固定用テープを強固に貼着して打ち抜かれ た配線器を基材フィルム1に連結した状態に確実 に保持できるようにすることを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記の目的を達成するために本発明によるテープキャリアの実装構造および実装方法は、以下の 構成としたものである。

また本発明によるテープキャリアの実装方法は、

テープキャリアの基材フィルム上に複数単位連続的に形成された配線群を、1単位毎に基材フィルムから打ち抜いて実装するに当たり、隣の合う配線群間の基材フィルム上に形成した金属箱がペーンと上記配線群とに固定用テープを貼着することにより、上記配線群が1単位毎に打ち抜かれた後も、各配線群が基材フィルム上に固定されたテープ状態でアウターリードボンディングを行うようにしたことを特徴とする。

〔作 用〕

*

上記の本発明によるテープキャリアの実装構造によれば、隣り合う配線群間の基材フィルム上に 会属箔パターンを形成したことにより、その金属箔パターンを介して固定用テープを基材フィルム上に強固に貼着することが可能となる。

また本発明によるテープキャリアの実装方法によれば、基材フィルム上に形成した金属箱パターンを介して固定用テープを基材フィルム上に強固に貼着され、配線群が1単位毎に打ち抜かれた後も、該配線群が基材フィルム上に固定されたテー

. - 7 -

L B 端子を他の部材に導電接続するための異方性 導電膜(異方性導電接着剤)を、隣り合う記線群 間にも延長して連続的に設けることにより、カット後の配線群の保持に乗用したものであるが、ても 記のような導電接続用の厚道膜とは別に設けても よい。その場合、固定用テープTの材質は、可能 性を有し、粘着性を有するものであれば適宜であ り、例えば、ボリィミド、ボリエステルなどの 脂や布、ガラス繊維布などでできたテープを用い ることができる。

上記ようなテープキャリアを実装するに当ていては、配線群2を1単位毎に前記カットラインしで打ち抜いて各配線群のOLB端子を接続すべき部材にボンディングするもので、その際、各配線群2は固定用テープ下により前記金属箔パターンを介して基材フィルム1上に強固に固定される。そして、その固定されたテープ状態で連続的にOLB工程に導き、スリットホール4内で固定用テープでをカットしてボンディングするもの共に、容の作業を連続的に行うことができると共に、容

プ状態でアウターリードボンディングを連続的に 行うことが可能となる。

〔実施例〕

第1図は本発明によるテープキャリアの実装構造の一実施例を示す平面図、第2図はその要部の拡大平面図、第3図は断面図であり、前記第4図~第6図と同一の機能を有する部材には同一の符号を付して再度の説明を省略する。

図示例は隣り合う配線群2・2間の基材フィルム1上に、金属箔パターン5を設け、その金属箔パターン5を介して前記固定用テープTを基材フィルム1上に貼着したものである。

上記金属箔パターン5の形状は、図示例に限らずストライプ状、マトリックス状、ベクパターンその他通宜である。

また金属箱パターン5の材質は、調その他適宜 であり、好ましくは配線群2と同材質のものを用い、その配線群2を形成する際に同時に形成する とよい。

固定用テープTは、本例においては配線群の O - 8 -

易に自動化することが可能となる。

なお上記実施例においては、金属箔パターンを 隣り合う配線群間の 1 箇所にのみ設けたが、 2 箇 所以上設けてそれぞれ固定用テープを貼着するこ ともある。

「発明の効果」

以上説明したように本発明によれば、強り合うを形式、なり合うを表現による解析の基材では、クーンを介して固定を介して固定を介して出たなり、プロルを持ていた後もなり、アインが強固にお着されいた後もなり、ディンが強固にお着されいた後もなり、ディンが強力が変更に対したができる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。特によいでできる。からないできる。

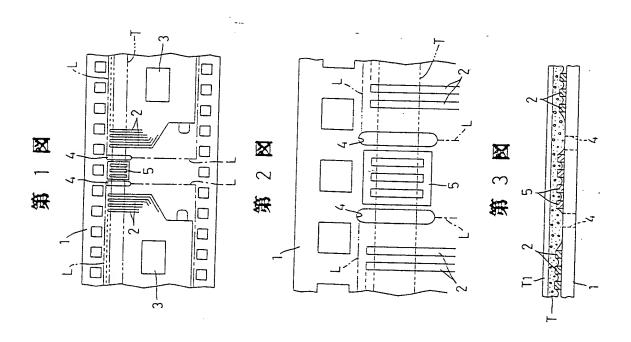
4. 図面の簡単な説明

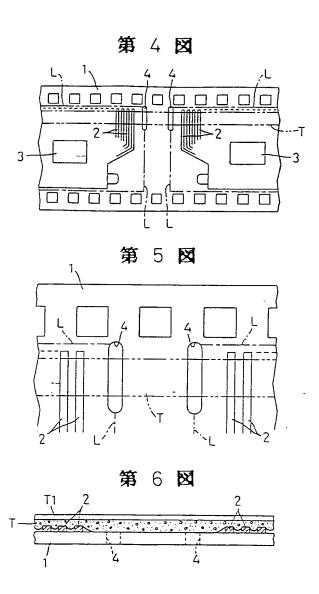
第1図は本発明によるテープキャリアの実装構造の一実施例を示す平面図、第2図はその要部の拡大平面図、第3図はその断面図、第4図は従来のテープキャリアの実装構造の一例を示す平面図、第5図はその要部の拡大平面図、第6図はその断面図である。

1 は基材フィルム、 2 は配線群、 3 は半導体チップ、 4 はスリットホール、 5 は金属箔パターン、 T は固定用テープ、 L はカットライン。

特 許 出 願 人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 菅 直 人 同 高 橋 隆 二

-11-





THIS PAGE BLANK (USPTO)